

報 告 書

製 業 規 格

日本工業規格

日本工業標準調査会の調査審議を経て、平成29年10月20日に下記の日本工業規格を制定及び改正したので、工業標準化法（昭和24年法律第185号）第16条の規定に基づき公示する。

平成29年10月20日

経済産業大臣 世耕 弘成

記

1. 制定された日本工業規格

滑り軸受一つば付き及び一つばなし薄肉半割り軸受—第1部：公差、設計及び検査方法	B1585—1
滑り軸受一つば付き及び一つばなし薄肉半割り軸受—第2部：肉厚及び一つば厚の測定	B1585—2
滑り軸受一つば付き及び一つばなし薄肉半割り軸受—第3部：周長の測定	B1585—3
顕微鏡対物レンズの性能及び表示—第3部：分光透過率	B7158—3
油圧—システム及び機器から発生する圧力脈動レベルの測定方法—第1部：ポンプの流量脈動及び内部インピーダンスの測定方法	B8349—1
生活支援ロボット—第1部：腰補助用装着型身体アシストロボット	B8456—1
次亜塩素酸水生成装置	B8701
人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100kHzの交流磁界及び交流電界の測定—第1部：測定器に対する要求事項	C1910—1
人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100kHzの交流磁界及び交流電界の測定—第2部：測定に対する要求事項	C1910—2
マイクロマシン及びMEMS—第26部：マイクロトレンチ構造及びマイクロニードル構造の寸法、形状表示及び計測法	C5630—26
計測用、制御用及び試験室用の電気装置—電磁両立性要求事項—第1部：一般要求事項	C61326—1
計測用、制御用及び試験室用の電気装置—電磁両立性要求事項—第2—1部：個別要求事項—EMC防護が施されていない感受性の高い試験用及び測定用の装置の試験配置、動作条件及び性能評価基準	C61326—2—1
計測用、制御用及び試験室用の電気装置—電磁両立性要求事項—第2—2部：個別要求事項—低電圧配電システムで使用する可搬形の試験用、測定用及び監視用の装置の試験配置、動作条件及び性能評価基準	C61326—2—2
半導体電力変換システム及び装置に対する安全要求事項—第1部：一般事項	C62477—1
家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャー—第31部：合成樹脂製のボックス、エンクロージャ、その他の付属品及びケーブル配線用スイッチボックスの個別要求事項	C8462—31
電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム—第3—1部：金属製線び、金属製線び用付属品及び金属製線び用ボックスの個別要求事項	C8471—3—1
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—低温特性の求め方—第1部：一般事項及び指針	K6261—1
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—低温特性の求め方—第2部：低温衝撃ぜい化試験	K6261—2
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—低温特性の求め方—第3部：低温ねじり試験（ゲーマンねじり試験）	K6261—3
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—低温特性の求め方—第4部：低温弾性回復試験（TR試験）	K6261—4
革試験方法—物理試験—第8部：耐屈曲性の測定—フレクソメータ法	K6557—8
革試験方法—染色堅ろう度試験—摩擦に対する染色堅ろう度試験—第1部：摩擦試験機Ⅰ形法	K6559—1
革試験方法—染色堅ろう度試験—摩擦に対する染色堅ろう度試験—第2部：摩擦試験機Ⅱ形法	K6559—2
革試験方法—染色堅ろう度試験—摩擦に対する染色堅ろう度試験—第3部：摩擦試験機VESLIC形法	K6559—3
情報技術—プロセスアセスメント—概念及び用語	X33001
情報技術—プロセスアセスメント—プロセスアセスメント実施に対する要求事項	X33002

2. 改正された日本工業規格